

第14回電解プロセス研究会

主催 電気化学会電解科学技術委員会

日時 9月10日(金) 午後1時～午後5時(13:00～17:00)

場所 京大会館102号室

(〒606-8305京都市左京区吉田河原町15-9TEL(075)751-8311(代))

参加費 会員及び学生： 無料

非会員： 1,000円

プログラム

1. 「常温熔融塩を電解液に用いたベンゼン類の電解フッ素化」

森田化学工業(株) 百田 邦堯氏

2. 「半導体・電子デバイス用CVDチャンバーのクリーニングシステムに用いられる
オンサイトフッ素発生装置の開発」

東洋炭素(株) 東城 哲朗氏

3. 「 $(\text{CH}_3)_4\text{NF} \cdot m\text{HF}$ 常温熔融塩を電解液に用いた新しい電解フッ素化プロセスの
開発」

同志社大学工学部PD 初代 善夫氏

世話人 同志社大 田坂明政 (0774-65-6592)

参加申し込み(締め切り8月31日)

氏名、連絡先(tel, fax, e-mail)明記の上、事務局まで

【事務局】〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5 横浜国立大学 大学院
工学研究院 機能の創生部門 光島重徳

TEL 045-339-4022、FAX 045-339-4024、e-mail: denkai@electrochem.jp